(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 7. August 2003 (07.08.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 03/065453 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 23/528, 23/58

[DE/DE]; Vogesenstrasse 3, 79276 Reute (DE). **SIEBEN, Ulrich** [DE/DE]; Kronengasse 7, 79276 Reute (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP03/00987

(74) Anwalt: SAUER, Wolfgang; Micronas GmbH, Hans-Bunte-Strasse 19, 79108 Freiburg (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:

31. Januar 2003 (31.01.2003)

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, KR, US.

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR).

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

Veröffentlicht:

(30) Angaben zur Priorität:

102 04 071.0 31. Januar 2002 (31.01.2002) DE 102 43 684.3 20. September 2002 (20.09.2002) DE

- mit internationalem Recherchenbericht
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
- vor Ablauf der f\(\tilde{u}\)r \(\tilde{A}\)nderungen der Anspr\(\tilde{u}\)che geltenden
 Frist; Ver\(\tilde{o}\)ffentlichung wird wiederholt, falls \(\tilde{A}\)nderungen
 eintreffen

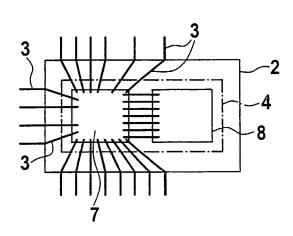
US): MICRONAS GMBH [DE/DE]; Hans-Bunte-Strasse 19, 79108 Freiburg (DE).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HEBERLE, Klaus

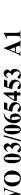
(54) Title: RECEPTACLE FOR A PROGRAMMABLE, ELECTRONIC PROCESSING DEVICE

(54) Bezeichnung: AUFNAHMEVORRICHTUNG FÜR EINE PROGRAMMIERBARE, ELEKTRONISCHE VERARBEITUNGSEINRICHTUNG



- (57) Abstract: The invention relates to a receptacle for a programmable, electronic processing device. Said receptacle is divided into at least one first and one second functional unit (7, 8), which represent separate, in particular monolithically integrated components. The first functional unit (7) defines all input and output interfaces of the whole processing device in terms of their electric properties. All basic connections of the second functional unit (8) can only be accessed externally by means of the first functional unit (7). For this purpose, the first functional unit (7) contains interface circuits, which electrically adapt the connections of the second functional unit (8) to the external conditions.
- (57) Zusammenfassung: Eine Aufnahmevorrichtung für eine programmierbare, elektronischen Verarbeitungseinrichtung. Diese ist in mindestens eine erste und zweite Funktionseinheit (7, 8) aufgeteilt, die separate, insbesondere monolithisch integrierte Bauelemente darstellen. Die erste Funktionseinheit (7) definiert alle Ein- und

Ausgangsschnittstellen der gesamten Verarbeitungseinrichtung bezüglich ihrer elektrischen Eigenschaften. Alle wesentlichen Anschlüsse der zweiten Funktionseinheit (8) sind von außen nur über die erste Funktionseinheit (7) zugänglich. Die erste Funktionseinheit (7) enthält hierzu Anpaßschaltungen, die der elektrischen Anpassung der Anschlüsse der zweiten Funktionseinheit (8) an die Außenbedingungen dienen.



Aufnahmevorrichtung für eine programmierbare, elektronische Verarbeitungseinrichtung

Die Erfindung betrifft eine Aufnahmevorrichtung im Sinne eines Bauelementegehäuses oder einer

PCT/EP03/00987

Umhüllung oder einer Trägereinrichtung für eine programmierbare, elektronische

Verarbeitungseinrichtung. Derartige Verarbeitungseinrichtungen bilden in der Regel einen Prozessor, der mindestens eine monolithisch integrierte Schaltung umfaßt. Je nach Anwendungsfall werden sowohl analoge als auch digitale Signale oder Daten verarbeitet. Die relativ kleinen elektronischen Bausteine erlauben es, diese Prozessoren auch noch mit Zusatzschaltungen, wie Speichern usw., in einem relativ kleinen Gehäuse unterzubringen. Man spricht wegen den kleinen Gehäuseabmessungen daher auch von Mikroprozessoren. Wenn mindestens zwei Einzelstrukturen in einer Aufnahmevorrichtung untergebracht sind, bezeichnet man dies zur Unterscheidung der Fälle, bei

Die Verwendung von Mikroprozessoren im Bereich der gesamten Technik nimmt ständig zu, da mit ihrer Hilfe Regelungs- und Steuerungsprozesse optimiert werden können. Der zusätzliche Aufwand ist dabei relativ gering und erlaubt dezentrale Lösungen. Ein großes Anwendungsfeld stellt hierbei der Maschinenbau dar, insbesondere der Kraftfahrzeugbereich, der zunehmend auf derartige Mikroprozessoren zurückgreift, um das Fahrzeugverhalten an den verschiedensten Stellen zu optimieren.

denen nur eine einzige monolithisch integrierte Schaltung vorliegt, auch als Hybridschaltung.

20

30

In vielen Fällen, bei denen derartige Prozessoren eingesetzt werden können, ergibt sich aber eine grundsätzliche Schwierigkeit dadurch, daß die Zykluszeiten für den Hersteller und den Anwender dieser Prozessoren sehr unterschiedlich sind. Wenn derartige Prozessoren Eingang in ein technisches System finden, dann sollte über die gesamte Entwicklungs-, Planungs-, Fabrikations- und

25 Betriebszeit des zugehörigen Systems ein möglichst gleichbleibendes Produkt für die Fertigung und den Ersatz zur Verfügung stehen.

Bei einer Technologieänderung sind neben den Änderungen der elektrischen Anschlußparameter auch die geänderten Empfindlichkeiten gegenüber Überspannungen, Verpolungen und gegenüber eingestrahlten elektromagnetischen Störungen zu berücksichtigen. Ferner ändert sich auch die Störwirkung gegenüber anderen Schaltungen, beispielsweise durch steilere Takt- und Datenflanken, die über relativ lange Leitungen als elektromagnetische Störsignale wirksam werden.

Die Entwicklung in der Halbleitertechnik eilt in der Regel dem durch den Anwender vorgegebenen Zeitrahmen davon, weil sie aktuellen Technologieveränderungen folgen muß, um immer komplexere Schaltungen realisieren zu können. Überholte Technologien weiter zu verwenden bedeutet parallele Produktionslinien, die in der Regel nicht wirtschaftlich sind, weil die Auslastung nicht gesichert ist.

5

Es ist daher Aufgabe der im Anspruch 1 gekennzeichneten Erfindung, hier einen geeigneten Lösungsweg anzugeben, der es einerseits dem Halbleiterhersteller ermöglicht, neueste Halbleiterherstellungsverfahren anzuwenden und andererseits auch ermöglicht, dem Anwender eine Garantie für ein langfristig konstantes Produkt anzubieten.

10

Diese Aufgabe wird durch die im Kennzeichen des Patentanspruchs 1 gegebene Lehre gelöst. Die Aufnahmevorrichtung nach der Erfindung und die Verarbeitungseinrichtung sind dabei nicht als unabhängige Teile anzusehen, sondern der Aufnahmevorrichtung wird eine erste Funktionseinheit der Verarbeitungseinrichtung zugeordnet, die im wesentlichen die elektrischen Außenbedingungen der 15 Verarbeitungseinrichtung definiert. Die eigentliche Verarbeitung findet dabei in einer zweiten Funktionseinheit statt, deren wesentlichen Anschlüsse im normalen Betriebsfall von außen nur über die externen Anschlüsse der ersten Funktionseinheit zugänglich sind. Unter wesentlichen Anschlüssen werden hierbei diejenigen Anschlüsse gerechnet, die bezüglich ihrer elektrischen Parameter von außen gesehen kritisch sind, weil ihre Toleranzen eng sind oder weil ihr aktives oder 20 passives Störverhalten zu beachten ist. Unkritische Anschlüsse, beispielsweise Set- oder Reset-Eingänge, können darunter fallen, müssen nicht unbedingt über die erste Funktionseinheit geführt werden, obgleich das langfristig im Hinblick auf die nicht voraussehbare Entwicklung der Technologie sicherer ist. Die Anordnung mit einer ersten und zweiten Funktionseinheit in einer Aufnahmevorrichtung ist ähnlich wie bei einer Hybridschaltung, hat hier jedoch einen ganz anderen 25 Zweck. Die erste Funktionseinheit, die auch aus mehr als einer monolithisch integrierten Schaltung bestehen kann, dient im wesentlichen nur dazu, die Außenbedingungen zu definieren und geeignete Anpaßschaltungen für die zweite Funktionseinheit zur Verfügung zu stellen. Dadurch wird die eigentliche Verarbeitungseinrichtung, die in der zweiten Funktionseinheit enthalten ist und die ebenfalls auch aus mehr als einer monolithisch integrierten Schaltung bestehen kann, gleichsam von 30 außen gesehen maskiert. Neben den reinen Anpaßschaltungen kann die erste Funktionseinheit auch Schaltungsteile von allgemeinerer Funktion enthalten, beispielsweise Oszillatoren, Regelschaltungen für Versorgungsspannungen, Pufferschaltungen, Schutzschaltungen usw. Die Regelschaltungen für Versorgungsspannungen ermöglichen einen autonomen Betrieb des Mikroprozessors in einem

Versorgungsnetz mit einer ungeregelten oder einer zu hohen Versorgungsspannung. Dies ist insbesondere für den Betrieb der zweiten Funktionseinheit wichtig, deren Versorgungsspannung gegebenenfalls an die verwendete Technologie angepaßt werden muß, andererseits aber für andere elektronische Schaltungen oder Meßeinrichtungen die ursprüngliche Versorgungsspannung beibehalten werden muß. Da in der Regel in der Verarbeitungseinrichtung auch Speichereinrichtungen vorhanden sind, werden deren Schreib- und Löschspannungen ebenfalls zweckmäßigerweise in der ersten Funktionseinheit erzeugt oder angepaßt.

5

25

30

Die Aufteilung in eine erste und zweite Funktionseinheit erlaubt nun, daß eine technologische Weiterentwicklung der eigentlichen Verarbeitungseinrichtung möglich ist, ohne daß dies von außen 10 berücksichtigt werden muß, sofern bei der ersten Funktionseinheit die Technologie beibehalten wird. Weiterentwicklungen der Technologie sind in der Regel mit höheren Verarbeitungsraten und kleineren Spannungspegeln verknüpft. Die Verarbeitungsraten erhöhen gegebenenfalls über die relativ langen Zuleitungen das zu berücksichtigende Störpotential. Die höheren Verarbeitungsraten 15 lassen wiederum für viele Vorgänge eine sequentielle Datenverarbeitung zu, für die zuvor wegen der geringeren Verarbeitungsgeschwindigkeit eine parallele Verarbeitung erforderlich war. Parallele Verarbeitungen haben aber in der Regel auch parallele Datenein- und -ausgänge zur Folge, wodurch die Anzahl der Anschlußkontakte und damit die erforderliche Kristallfläche erhöht wird. Somit ist es trotz der zunehmenden Funktionalität der Prozessoren erforderlich, die Anzahl der Anschlußkontakte 20 möglichst nicht in gleicher Weise zunehmen zu lassen, sondern zu begrenzen. Eine serielle Ein- und Ausgabe der Daten in der zweiten Funktionseinheit ist somit anzustreben. Dies erfordert aber in der ersten Funktionseinheit entsprechende Umsetzungseinrichtungen.

Wenn die Anpaßschaltungen nicht fest, sondern programmierbar sind, ist die Flexibilität natürlich noch größer, denn dann ist eine Anpassung über das Programm möglich. Ändern sich bei dem Prozessor durch eine neue Technologie beispielsweise die Ein- und Ausgangspegel, dann werden die neuen Spannungspegel der Anpaßschaltungen entsprechend über das Programm angepaßt.

Die Erfindung und vorteilhafte Weiterbildungen werden nun anhand der Figuren der Zeichnung näher beschrieben:

Fig. 1 zeigt schematisch die Aufsicht auf eine typische Aufnahmevorrichtung für eine monolithisch integrierte Schaltung nach dem Stand der Technik,

- Fig. 2 zeigt schematisch die Aufsicht auf eine typische Aufnahmevorrichtung für eine Hybridschaltung nach dem Stand der Technik,
- Fig. 3 zeigt schematisch die Aufsicht auf eine Aufnahmevorrichtung nach der Erfindung für die Aufnahme einer lateralen Anordnung von einer ersten und zweiten Funktionseinheit,
- Fig. 4 zeigt schematisch in Aufsicht eine Aufnahmevorrichtung nach der Erfindung zur Aufnahme einer Stapelanordnung der ersten und zweiten Funktionseinheit,
 - Fig. 5 zeigt schematisch in Aufsicht eine Aufnahmevorrichtung nach der Erfindung zur Aufnahme einer Kombination aus einer Stapelanordnung und einer lateralen Anordnung,
- Fig. 6 zeigt schematisch in Aufsicht eine Aufnahmevorrichtung nach der Erfindung, bei der alle
 Kontakte der ersten und zweiten Funktionseinheit zunächst auf einen passiven Träger geführt sind,
 und
 - Fig. 7 zeigt schematisch als seitliches Schnittbild eine Aufnahmevorrichtung etwa gemäß Fig. 6, wobei die externen Anschlußkontakte allerdings durch ein Array von Lötpunkten definiert sind.
- In Fig. 1 ist schematisch in Aufsicht die typische Anordnung einer monolithisch integrierten Schaltung 1 in einer Aufnahmevorrichtung nach dem Stand der Technik dargestellt. Als Aufnahmevorrichtung dient dabei meist ein thermisch verpreßbares Kunststoffgehäuse, dessen äußere Umrandung durch eine Linie 2 wiedergegeben ist. Der Träger der monolithisch integrierten Schaltung 1 ist in der Regel ein flaches Stanzteil 3 aus Metall, das sogenannte "Frame", das einmal die elektrischen Durchführungen für die Anschlußkontakte der monolithisch integrierten Schaltung durch das Kunststoffgehäuse bildet und zum anderen auch eine Plattform 4 zur Aufnahme der monolithisch integrierten Schaltung 1 enthält. In der Regel ist diese Plattform mit einem nach außen führenden Masseanschlußkontakt verbunden. Die Anschlußkontakte der monolithisch integrierten Schaltung 1 sind über Bondverbindungen mit den zugehörigen inneren Anschlüssen des Frames 3 verbunden. Alle externen Zuleitungen zur monolithisch integrierten Schaltung 1 führen über das Frame 3.
- Fig. 2 zeigt schematisch die Aufsicht auf eine Hybridschaltung nach dem Stand der Technik. Die Hybridschaltung besteht hierbei aus zwei monolithisch integrierten Schaltungen 5, 6. Wird als
 Träger wieder ein Frame 3 mit einer Plattform 4 verwendet, dann befinden sich beide monolithisch integrierten Schaltungen nebeneinander auf dieser Plattform. Die Kontaktierungen der monolithisch integrierten Schaltungen 5, 6 erfolgen über Bondverbindungen, die entweder auf die zugehörigen Anschlußbeine des Frames 3 geführt werden oder direkt von Schaltung zu Schaltung. In einigen

Fällen verwendet man auch eine Stapelanordnung, bei der die kleinere Schaltung auf die größere aufgeklebt wird. Bei der kleineren Schaltung handelt es sich meist um Speicherschaltungen oder Schaltungen mit speziellen Bauelementen wie Kondensatoren, Spulen, Filtern usw.

- Hybridschaltungen werden gerne dort verwendet, wo Schaltungsteile mit unterschiedlichen Grundfunktionen zusammenwirken, beispielsweise eine Analogschaltung und eine Digitalschaltung, eventuell auch noch in Verbindung mit unterschiedlichen Speichertypen. Für jede Schaltung steht damit die optimale Technologie zur Verfügung. Es können auch Produkte unterschiedlicher Hersteller auf diese Weise miteinander kombiniert werden. Als Aufnahmevorrichtungen für
 Hybridschaltungen finden sich auch ganze Schaltungsplatinen, wobei die Kontaktierung in der Regel ebenfalls über Bondverbindungen erfolgt. Die einzelnen Schaltungen und die Bondverbindungen auf der Platine werden dann durch eine Kunststoffumhüllung geschützt.
- In Fig. 3 ist schematisch die Aufsicht auf eine Aufnahmevorrichtung nach der Erfindung mit einer lateralen Anordnung von einer ersten und zweiten Funktionseinheit 7, 8 dargestellt. Die laterale Anordnung der beiden monolithisch integrierten Funktionseinheiten 7, 8 ist relativ ähnlich zur nebenstehenden Anordnung der beiden monolithisch integrierten Schaltungen 5, 6 von Fig. 2. Der Unterschied besteht allerdings darin, daß in Fig. 3 alle äußeren Kontakte nur mit der ersten Funktionseinheit 7 verbunden sind und die zweite Funktionseinheit 8 nur Verbindungen zur ersten Funktionseinheit 7 aufweist. Der gemeinsame Masseanschluß über die Plattform 4 stellt dabei eine Ausnahme dar. Die Fig. 3 zeigt schon in der schematischen Darstellung, daß bei der Verwendung eines Frames 3 diese Aufnahmevorrichtung auf relativ wenige äußere Anschlußbeine begrenzt ist, weil die Bondverbindungen nur eine begrenzte Geometrie der Kontaktierung zulassen und ein Ausgleich durch die Ausgestaltung der internen Frame-Zuführungen nur teilweise möglich ist. Eine gewisse Abhilfe stellt hier die in Fig. 4 dargestellte Stapelanordnung dar.

Bei der in Fig. 4 dargestellten schematischen Stapelanordnung mit zwei oder mehr Schaltungsteilen auf einer Frame-Plattform 4 bleibt eine zentrale Anordnung wie etwa in Fig. 1 erhalten, so daß alle inneren Frame-Kontakte des Frames 3 vom Rand der ersten Funktionseinheit 7 aus über Bondverbindungen gut erreichbar sind. Durch die Stapelanordnung kommt der ersten Funktionseinheit 7 eine Trägerfunktion für die zweite Funktionseinheit 8 zu. Dies setzt natürlich voraus, daß die Kristallfläche der ersten Funktionseinheit 7 wesentlich größer als die Kristallfläche

30

der zweiten Funktionseinheit 8 ist. Die Gehäuseumrandung bzw. die Grenze der Kunstoffumhüllung wird durch die Linie 2 dargestellt.

Fig. 5 zeigt schematisch als Ausführungsbeispiel eine Kombination aus einer Stapelanordnung und einer lateralen Anordnung auf einer Frame-Plattform 4. Die Stapelanordnung entspricht dabei etwa Fig. 4 und die laterale Anordnung etwa Fig. 3. Die erste Funktionseinheit 7 trägt die zweite Funktionseinheit 8 und ist aber auch noch lateral mit einer weiteren zweiten Funktions- oder Hilfseinheit 9 verbunden, die sich auf der gemeinsamen Frame-Plattform 4 befindet. Alle nach außen weisenden Anschlüsse gehen nur über die ersten Funktionseinheit 7. Bei der Einheit 9 kann es sich beispielsweise um einen Speicherbaustein handeln. Ob dessen Anschlüsse mittelbar über die erste Funktionseinheit 7 oder direkt durch Bondverbindungen auf die zweite Funktionseinheit 8 geführt sind, hängt in erster Linie von den räumlichen Gegebenheiten ab. Die Gehäuseumrandung bzw. die Grenze der Kunstoffumhüllung wird durch die Linie 2 dargestellt.

Fig. 6 zeigt schematisch in Aufsicht ein Ausführungsbeispiel für die Aufnahmevorrichtung, bei der 15 das Problem der schlechten Zugänglichkeit der äußeren Anschlüsse 30 von der ersten Funktionseinheit 7 infolge der lateralen Anordnung der ersten und zweiten Funktionseinheit 7, 8 gelöst ist. Ein elektrisch isolierender Träger 10, der beispielsweise aus einer Keramikmasse mit einer oberflächig aufgebrachten Verdrahtungsebene 11 besteht, nimmt an deren Oberfläche die erste und 20 zweite Funktionseinheit 7, 8 auf. Die Verdrahtungsebene 11 kann dabei aus mehreren, voneinander isolierten Verdrahtungsschichten bestehen, um alle Verbindungsleitungen 12, 13, 14, 15, 16 17 und zugehörige Kontaktierungszonen 20 zu bilden. Über Bondverbindungen 40 werden die Zwischenverbindungen von der ersten und zweiten Funktionseinheit 7, 8 zu den Kontaktierungszonen 20 der Verbindungsleitungen hergestellt. Die Verbindungsleitungen sind gegeneinander und 25 gegenüber der Oberfläche isoliert und können sich daher beliebig kreuzen oder unter der ersten oder zweiten Funktionseinheit 7, 8 hindurchgeführt werden, vergleiche beispielsweise die Kreuzung der Leitungen 15, 16 und die Leitung 17, die unterhalb der zweiten Funktionseinheit 8 verläuft. Dadurch sind alle äußeren Anschlüsse 30 der Aufnahmevorrichtung von der ersten Funktionseinheit 7 aus gut erreichbar. Der Träger 10 ist auch mit den äußeren Anschlüssen 30 verbunden oder diese sind in den 30 Träger bei dessen Herstellung schon eingebettet worden. Das Ganze wird von einer Kunststoffumhüllung umschlossen, deren Umrandung durch die strichpunktierte Linie 2 dargestellt

ist.

Fig. 7 zeigt schließlich schematisch als seitliches Schnittbild eine weitere Aufnahmevorrichtung mit einem Träger 10 und einer lateralen Anordnung der ersten und zweiten Funktionseinheit 7, 8. Die Anordnung ist dabei etwa ähnlich wie bei Fig. 6. Im Unterschied dazu sind die externen Anschlußkontakte aber durch ein Array von Lötpunkten 35 definiert. Diese Anordnung wird dort verwendet, wo die Anzahl der externen Anschlußkontakte so hoch ist, daß bei einer linearen Anordnung der Anschlußkontakte an den Rändern die gegenseitigen Abstände zu klein werden. Die Lötpunkte 35 sind mit jeweils einer Trägerdurchführung 36 verbunden, der die elektrische Verbindung zur Verdrahtungsebene 11 herstellt. In der Seitenansicht sind auch gut die Bondverbindungen 40 von der ersten und zweiten Funktionseinheit 7, 8 auf die Verdrahtungsebene 10 11 zu sehen.

Die Erfindung ist selbstverständlich bei der Aufteilung in eine erste und zweite Funktionseinheit nicht auf die Verwendung von monolithisch integrierten Schaltungen beschränkt. Wenn es sich als zweckmäßig erweist, können auch andere Herstellungsverfahren für die einzelnen Schaltungsteile verwendet werden. Wichtig ist allein, daß von außen ein elektrisch konstantes Verhalten der Verarbeitungseinrichtung gewährleistet wird, das durch die Maskierung der eigentlichen Verarbeitungseinrichtung mittels einer ersten Funktionseinheit mit konstanten elektrischen Parametern erreicht wird.

5

15

25

Patentansprüche

- Aufnahmevorrichtung mit einer programmierbaren, elektronischen Verarbeitungseinrichtung, insbesondere einem Mikroprozessor, die mindestens in eine erste und zweite Funktionseinheit (7, 8) aufgeteilt ist, die separate, insbesondere monolithisch integrierte, Bauelemente darstellen,
 - dadurch gekennzeichnet, daß
- die erste Funktionseinheit (7) alle Ein- und Ausgangsschnittstellen der Verarbeitungseinrichtung
 bezüglich ihrer elektrischen Eigenschaften definiert,
 - alle wesentlichen Anschlüsse der zweiten Funktionseinheit (8) von außen nur über die erste Funktionseinheit (7) zugänglich sind, wobei unmittelbarer Zugänge in der Regel ausgeschlossen sind, und
 - die erste Funktionseinheit (7) Anpaßschaltungen enthält, die der elektrischen Anpassung der Anschlüsse der zweiten Funktionseinheit (8) an die Außenbedingungen dienen.
- Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Aufnahmevorrichtung zunächst unbestückt ist oder nur einen Teil der programmierbaren elektronischen Verarbeitungseinrichtung enthält, wobei die Aufnahmevorrichtung so ausgebildet ist, daß der fehlende Teil oder die fehlenden Teile der Verarbeitungseinrichtung nachträglich einfügbar sind.
 - 3. Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der in der Aufnahmevorrichtung enthaltene Teil der ersten Funktionseinheit (7) zuzurechnen ist.
 - Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens in einer der Anpaßschaltungen eine Änderung eines Spannungspegels erfolgt.
- 5. Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Versorgungsanschluß der zweiten Funktionseinheit (8) über die erste Funktionseinheit (7) gespeist ist, wobei die Anpaßschaltung einen Spannungsregler enthält.

 Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens in einer der Anpaßschaltungen eine Änderung eines Strompegels erfolgt.

5

15

25

- 7. Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens in einer der Anpaßschaltungen eine Umsetzung von einem seriellen Datenstrom in einen parallelen Datenstrom oder von einem parallelen Datenstrom in einen seriellen Datenstrom erfolgt.
- 8. Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß
 10 mindestens in einer der Anpaßschaltungen eine Zwischenspeicherung von ein- oder ausgehenden Daten erfolgt.
 - 9. Aufnahmevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine der Anpaßschaltungen in ihren elektrischen Eigenschaften programmierbar ist.
 - 10. Aufnahmevorrichtung nach Anspruche 9, dadurch gekennzeichnet, daß für mindestens eine der Anpaßschaltungen ein Meßmodus programmierbar ist.
- 11. Aufnahmevorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß im Meßmodus mindestens für eine der Anpaßschaltungen ein direkter Signalpfad von einem nach außen führenden Anschluß der Aufnahmevorrichtung zu einem Anschluß der zweiten Funktionseinheit (8) mittels des Programms durchschaltbar ist, wobei der über die Anpaßschaltung führende mittelbare Signalpfad abgeschaltet ist.

WO 03/065453 PCT/EP03/00987



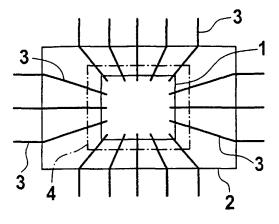


Fig. 1

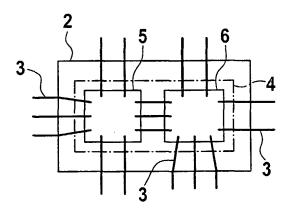


Fig. 2

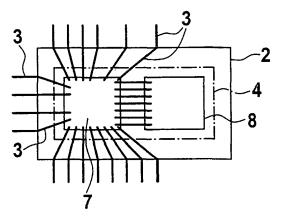


Fig. 3

WO 03/065453 PCT/EP03/00987

2/3

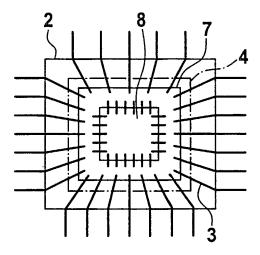
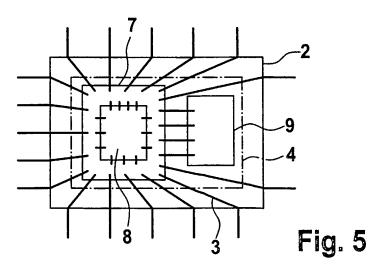


Fig. 4



WO 03/065453 PCT/EP03/00987

3/3

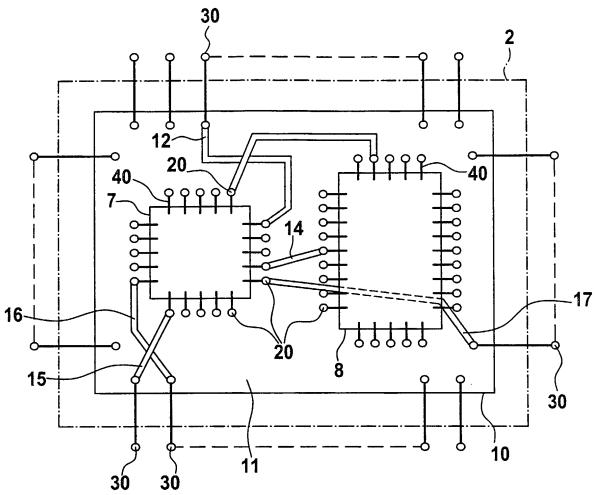
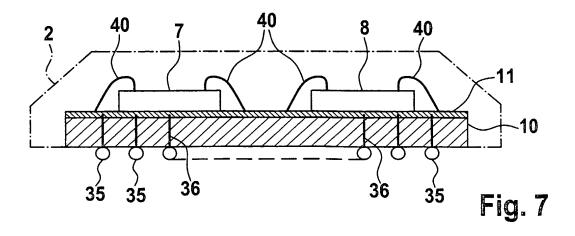


Fig. 6



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

I Application No PCT/EP 03/00987

A. CL	_ASSIFIC/	MOITA	OF SUB	JECT M	IATTER		
IPC	7	H011	23/5	28	H01L	.23	158

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

 $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) \\ IPC 7 & H01L \end{tabular}$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

PAJ, EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	he relevant passages	Relevant to claim No.
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 03, 30 March 2000 (2000-03-30) & JP 11 354643 A (MITSUBISHI CORP), 24 December 1999 (1999 abstract; figure 3		1-11
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 09, 30 July 1999 (1999-07-30) & JP 11 111913 A (FUJI XEROX 23 April 1999 (1999-04-23) abstract	CO LTD),	1-11
Α	US 5 726 500 A (BOIS PHILIPPE 10 March 1998 (1998-03-10) column 2, line 41 -column 3,		1-11
X Furti	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	l in annex.
"A" docume consider of filing of the citation	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"T" later document published after the intor priority date and not in conflict with cited to understand the principle or triunder invention. "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the difference of the cannot be considered to involve an indocument is combined with one or ments, such combination being obvious the art. "&" document member of the same pater.	h the application but heory underlying the claimed invention of the considered to ocument is taken alone claimed invention inventive step when the lore other such docupous to a person skilled
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	earch report
2	1 May 2003	1 1. 06. 2003	
Name and r	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer ANNA FLODMAN / E	LY

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter I Application No
PCT/EP 03/00987

	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 6 222 213 B1 (FUJIWARA MAKOTO) 24 April 2001 (2001-04-24) column 6, line 64 -column 8, line 19	1-11

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inti I Application No PCT/EP 03/00987

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)			Publication date
JP 11354643	Α	24-12-1999	NONE			
JP 11111913	Α	23-04-1999	JР	3191743	B2	23-07-2001
US 5726500	A	10-03-1998	FR FR DE DE EP WO	2718570 2718571 69501195 69501195 0702850 9528006	A1 D1 T2 A1	13-10-1995 13-10-1995 22-01-1998 16-04-1998 27-03-1996 19-10-1995
US 6222213	B1	24-04-2001	JP JP	3380465 2000021987		24-02-2003 21-01-2000

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern les Aktenzeichen PCi/Er 03/00987

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L23/528 H01L23/58

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

PAJ, EPO-Internal, WPI Data

ategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 03, 30. März 2000 (2000-03-30) & JP 11 354643 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 24. Dezember 1999 (1999-12-24) Zusammenfassung; Abbildung 3	1-11
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 09, 30. Juli 1999 (1999-07-30) & JP 11 111913 A (FUJI XEROX CO LTD), 23. April 1999 (1999-04-23) Zusammenfassung	1-11
	US 5 726 500 A (BOIS PHILIPPE ET AL) 10. März 1998 (1998-03-10) Spalte 2, Zeile 41 -Spalte 3, Zeile 12	1-11

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
21. Mai 2003	1 1. 06. 2003
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter ANNA FLODMAN / ELY

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interi es Aktenzeichen
PCI/EP 03/00987

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN								
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.						
A	US 6 222 213 B1 (FUJIWARA MAKOTO) 24. April 2001 (2001-04-24) Spalte 6, Zeile 64 -Spalte 8, Zeile 19	1-11						
į		1						

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interr Aktenzeichen
PCI/EP 03/00987

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
JP	P 11354643 A 24-12-1999		KEII	NE		
JP	JP 11111913 A 23-04-1999		JP 3191743 B2		23-07-2001	
US	5726500	A	10-03-1998	FR FR DE DE EP WO	2718570 A1 2718571 A1 69501195 D1 69501195 T2 0702850 A1 9528006 A1	13-10-1995 13-10-1995 22-01-1998 16-04-1998 27-03-1996 19-10-1995
US	6222213	B1	24-04-2001	JP JP	3380465 B2 2000021987 A	24-02-2003 21-01-2000